

Plateforme CERTeM R&D

La plateforme CERTeM R&D est une **salle blanche (classe 100)** de 400m² composée d'équipements pour la **fabrication de composants de l'échantillon à la plaquette de 8 pouces.**



- Hotte de gravure - Lay Concept
- Hotte H3PO4- Lay Concept
- Hotte solvant - Lay Concept
- Hotte SiPoreux - Lay Concept
- Scrubber post CMP - SSEC
- Séchage super critique - Separex



Préparation de surface

- Etuve HMDS - hexaméthylsilazane (promoteur d'adhérence)
- Etuve - évaporation de solvant et séchage

Application de la résine photosensible

- Equipements d'enduction de résine manuelle et automatisée
- Equipement de dépôt résine par spray : Coater spray (Alta spray) SUSS

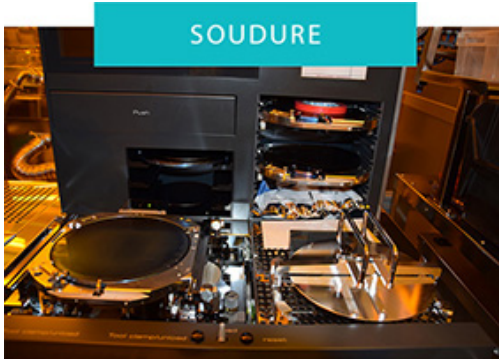
- Lamineuse pour film sec photosensible

Exposition

- Aligneurs de masque - SUSS Microtec
- Aligneurs de masque double face - EVG (avec option lithographie par nano-impression - UV-NIL (UltraViolet NanoImprint Lithography))
- Lithographie laser OPTEC

Développement et retrait résine

- Développeurs aqueux et solvant - Optiwet
- Equipement de retrait résine par plasma O2



- Equipement de collage de plaquette semi-automatisé - EVG
- Equipement de décollement de plaquette



- Usineur ionique - IBE (Ion Beam Etching)
- Equipements de gravure ionique réactive - RIE/ICP (Reactive Ion Etching/Inductively Coupled Plasma)



- Ablateur laser pour dépôt de couches minces
- Equipement de dépôt métallique par évaporation sous vide avec lift-off - PLASSYS
- Equipements de dépôt métallique par pulvérisation cathodique - PVD sputtering (Physical Vapor Deposition) - de T° ambiante à 700°C - PLASSYS

- Equipement de dépôt de diélectrique assisté par plasma - PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) - PLASMALAB 100 Oxford
- Equipement de dépôt de diélectrique assisté par plasma LT-PECVD (Low Temperature PECVD) - AVIZA
- Equipement de dépôt basse pression - LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) SiN et SiPoly dopé



- Four SiC CentroTherm - Recuit HT SiC
- Four RTA Rapid thermal Annealing



- Mesure 4 pointes
- Ellipsomètre spectroscopique - SEMILAB
- Profilomètre mécanique - KLA Tencor
- Spectromètre de masse



- Microscope optique

- Microscope 3D